

Technische Daten WaveSensor

WaveSensor	150	150 mit Reflex-Modul
Sensorbereich	15 mm x 15 mm	15 mm x 15 mm
Wellenlänge	405 nm ... 1.100 nm ¹⁾	405 nm ... 1.100 nm ¹⁾
Wellenfront Genauigkeit	$< \lambda/20$ (RMS)	0,05 μm (RMS)
Wellenfront Wiederholgenauigkeit	$< \lambda/200$ (RMS)	0,005 μm (RMS)
Dynamikbereich	2.000 λ	2.000 λ
Messfrequenz	Bis zu 12 Hz	Bis zu 12 Hz
Laterale Auflösung	138 x 138 Mikrolinsen	138 x 138 Mikrolinsen

1) Nach Kundenwunsch

Technische Daten WaveMaster® für F&E

WaveMaster®	Compact 2	Compact 2 Reflex	Compact 2 Universal
Prüflingsdurchmesser	0,5 mm ... 14 mm ^{2),3)}	4,5 mm ... 18 mm ^{3),5)}	Transmission: 0,5 mm ... 14 mm ^{2),3)} Reflexion: 4,5 mm ... 14 mm ^{3),5)}
Brennweite (Messkonfiguration)	-30 mm ... +100 mm ⁴⁾	-	-30 mm ... +100 mm ⁴⁾
Krümmungsradius	-	-50 mm ... 30 mm ⁶⁾	-50 mm ... 30 mm ⁶⁾
Prüflingshalter	Einzelprüfplatz, manuelle Positionierung	Einzelprüfplatz, manuelle Positionierung	Einzelprüfplatz, manuelle Positionierung
Maximum Asphärität	-	≤ 7° ⁷⁾	≤ 7° ⁷⁾

2) Abhängig vom Teleskop

3) Weitere auf Anfrage

4) Abhängig vom Mikroskop

5) Abhängig vom Krümmungsradius und der Beleuchtungsoptik

6) Abhängig vom Prüflingsdurchmesser und der Beleuchtungsoptik

7) Lokale Abweichungen von der best-passenden Sphäre

Technische Daten WaveMaster® für F&E

WaveMaster®	PLAN	Field	UST
Prüflingsdurchmesser	0,5 mm ... 14 mm ^{2,3)}	0,5 mm ... 14 mm ^{2,3)}	Bis zu 1.100 mm x 650 mm x 1.200 mm
Prüflingshalter	Einzelprüfplatz, manuelle Positionierung	Einzelprüfplatz, manuelle Positionierung	Schnittstelle für kundenspezifische Linsenhalter
Maximum Prüflingsgewicht	-	-	450 kg
Maximaler Abstand zwischen Objekt- und Bildebene	-	-	1.200 mm
Maximale Feldgröße, bildseitig	-	±20 mm	100 mm x 100 mm
Maximale Feldgröße, objektseitig	-	±70°	70 mm x 45 mm

2) Abhängig vom Teleskop

3) Weitere auf Anfrage

Technische Daten WaveMaster® für die Produktion

WaveMaster®	PRO 2	PRO 2 Wafer	PRO 2 PLAN
Prüflingsdurchmesser	0,5 mm ... 14 mm ²⁾	0,5 mm ... 14 mm ²⁾	0,5 mm ... 14 mm ²⁾
Anlagemaß	-12 mm ... +50 mm ⁴⁾	-12 mm ... +50 mm ⁴⁾	-
Prüflingshalter	Tray	Wafer-Halter	Tray
Messzeit pro Optik	< 3 s ⁸⁾	< 3 s ⁸⁾	< 3 s ⁸⁾
Prüflingsdurchsatz pro Stunde	≥ 1.200 Linsen ⁸⁾	≥ 1.200 Linsen ⁸⁾	≥ 1.200 Linsen ⁸⁾
Linsen pro Tray	Max. 148 ⁸⁾	-	Max. 148 ⁸⁾
Austauschzeit für Tray mit Linsen	10 s	10 s	10 s
Wafer tray Austauschzeit, inkl. Einrichtung	< 2 min	< 2 min	< 2 min
Einrichtzeit für neues Linsendesign	< 5 min	< 5 min	< 5 min

2) Abhängig vom Teleskop

4) Abhängig vom Mikroskop

8) Abhängig vom Prüfling